

第11回 <KTR注目テーマ報告会>のお知らせ

KTR

2026年5月15日(金)

お待たせしておりました2026年度のKTR注目テーマ報告会のご案内です。第11回目の本報告会では、「フッ素フリー表面処理の新展開」と題して開催いたします。

基調講演として産総研/穂積様をお招きし、最新の新規な表面処理技術についてご講演いただきます。また、弊社からも関連するPFAS代替技術の動きをご紹介します。皆様からの奮ってのご参加を心よりお待ちしております。

開催日時：2026年6月26日(金) 10:30～12:00

①基調講演	10:30～11:30 (Q&A含む) 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 上席主任研究員 穂積 篤 氏 「新規なフッ素フリー表面処理技術～相反機能を両立するliquid-like表面の創製～」
内容	ガラスのような親水性基板上では、表面の水酸基と水分子との間に強固な水素結合が形成されるため、水滴はぬれ広がりやすく滑落しにくい。そのため、従来は、表面自由エネルギーの低いフッ素化合物を含む分子を高密度(solid-like)に充填した表面を形成することが液滴の除去に最も有効であると広く考えられてきた。 本講演では、こうした従来の発想とは対極にある新たなアプローチとして、従来は親油性あるいは親水性を示すと考えられてきた分子を、疎な状態(liquid-like)で表面に配置し、その分子運動性を活用することで「親油性／親水性でありながら優れた滑落性を示す」という相反する機能を両立させる新しいフッ素フリーな表面処理技術について紹介する。
②KTR講演	11:30～12:00 (Q&A含む) KTR コンサルティングスタッフ 山本 美輪 「PFAS代替技術の最新動向-半導体分野の観点から-」
内容	半導体分野におけるPFASの使用量は、全体の使用量と比べるとほんの僅かと言えます。しかしながら、「撥水・撥油を両立」し、耐薬品性、低付着性なども付与できる唯一無二の材料であるPFASは、フォトリソグラフィ、エッチング、洗浄、配管・シール、フィルターなど、多岐に亘って性能・歩留まりを支える、不可欠な材料です。今回は、各製造工程や材料におけるPFASの使用実態と代替の困難性を整理し、その代替の方向性に関するエッセンスをお話させていただきます。

開催形式: Zoomによるオンライン開催

(先着100名様締切/定員に達し次第、締め切らせていただきます)

参加費用: KTRコンサルテーション会員: 3,300円(税込) / 1名

一般(非会員) : 8,800円(税込) / 1名

申込: 下記URLより承ります

>> <https://forms.office.com/r/UZ46YKVmrV>

ご質問やご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。



申込フォーム
QRコード